【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【公開番号】特開2011-77435(P2011-77435A)
【公開日】平成23年4月14日(2011.4.14)
【年通号数】公開・登録公報2011-015
【出願番号】特願2009-229541(P2009-229541)
【国際特許分類】
　Ｈ０１Ｌ　21/02　　(2006.01)
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/02　　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年9月25日(2012.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板処理に関する情報を操作する操作画面の表示を制御する制御手段と、
基板処理に関する情報を時刻に関連付けて記憶する記憶手段と
を有する基板処理装置であって、
前記制御手段は、前記記憶手段に記憶される情報のうちいずれかが選択された場合、選択された情報の時刻に関連付けられる他の情報が表示可能となるよう制御する基板処理装置。
【請求項２】
基板処理に関する情報を操作する操作画面に表示する表示工程を有する基板処理装置の表示方法であって、
前記表示工程では、前記基板処理に関する情報のうちいずれかの情報が選択された場合、選択された情報の時刻に関連付けられる他の情報が表示される基板処理装置の表示方法。
【請求項３】
基板を処理する基板処理工程と、
基板処理に関する情報を操作する操作画面に表示する表示工程と、を有する半導体装置の製造方法であって、
前記基板処理工程では、基板処理に関する情報を時刻と関連付け、
前記表示工程では、前記基板処理に関する情報のうちいずれかの情報が選択された場合、選択された情報の時刻に関連付けられる他の情報が表示される半導体装置の製造方法。